

超高純度ガス精製器 ファインピュアラー

複数の触媒及び吸着剤の組み合わせにより、
簡単・低コストでppbレベルの超高純度ガスが得られます。

まとめ買い
キャンペーン

定価より

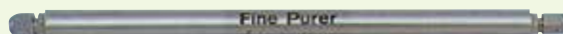
20%オフ!!

2023年12月末まで

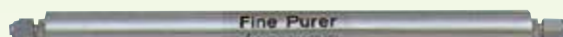
ストック用に まとめ買いキャンペーン実施中!!



FPI (H) -3/FPI (H) -5
~3.0/~5.0 (Nℓ/min)



FPI-15/FPH-30
~15/~30 (Nℓ/min)



FPI-30/FPH-60
~30/~60 (Nℓ/min)



FPI-50/FPH-100
~50/~100 (Nℓ/min)



FPI-300
~300 (Nℓ/min)

低価格

徹底したコスト管理

短納期

3週間で納品可能
(国内製造)

再生可能

低コストで
長期間使用可能

不活性ガス、水素に対応

当該技術の適用先(用途)

- 微量分析計用キャリアガス、ゼロガス
- 溶接用シールドガス
- 各種半導体製造装置、CVD装置など、高純度を要求される雰囲気ガス、パージガス

キャンペーン対象機種

不活性ガス用 バルブ無し

	適用 ガス	流量 Nℓ/min ^{※1}	型 式	使用圧力範囲 (MPaG) ^{※2}	圧力損失 (kPaG) ^{※3}	使用温度 (℃)	入口ガス 純度条件	本体材質	内蔵フィルター (μm)	重量 (kg)	接続	寿命・精製量 ^{※1 ※4} (約Nm ³)
①	N ₂ Ar He Ne Xe Kr	～3.0	FPI-3	0.1～0.97	5 以下	5～35	5Nガスボンベ 相当以上	SUS316L	0.003 (材質:SUS316L)	0.2	1/4VCR オス	33
②		～5.0	FPI-5		15 以下					0.3		56
③		～15.0	FPI-15		25 以下					0.7		585
④		～30.0	FPI-30	0.2～0.97	40 以下					1.0		916
⑤		～50.0	FPI-50		35 以下					1.6		2,054
⑥		～300.0	FPI-300		34 以下 ^{※5}					5.0	1/2VCR オス	36,000

※1 NℓおよびNm³とは273.15 K(0℃)で101.325 kPaGの状態を示します。 ※2 最大流量時の使用圧力範囲を示します。 ※3 最大流量時において精製器入口圧力を0.5 MPaGとした場合の圧力損失を示します。
 ※4 暫定参考値ですので変更される場合があります。 ※5 最大流量時において精製器入口圧力を0.3 MPaGとした場合の圧力損失を示します。

不活性ガス用 バルブ付き

	適用 ガス	流量 Nℓ/min ^{※2}	型 式	使用圧力範囲 (MPaG) ^{※3}	圧力損失 (kPaG) ^{※4}	使用温度 (℃)	入口ガス 純度条件	本体材質	内蔵フィルター (μm)	重量 (kg)	接続	寿命・精製量 ^{※2 ※5} (約Nm ³)
①	N ₂ Ar He Ne Xe Kr	～3.0	FPI-3V	0.1～0.97	5 以下	5～35	5Nガスボンベ 相当以上	SUS316L	0.003 (材質:SUS316L)	0.8	1/4VCR メス	33
②		～5.0	FPI-5V		15 以下					0.9		56
③		～15.0	FPI-15V		25 以下					1.3		585
④		～30.0	FPI-30V	0.2～0.97	40 以下					1.6		916
⑤		～50.0	FPI-50V		35 以下					2.2		2,054
⑥ ^{※1}		～100.0	FPI-100V		38 以下					8.6	3/8VCR メス	11,200

※1 FPI-100Vのバルブ無し仕様はありません。 ※2 NℓおよびNm³とは273.15 K(0℃)で101.325 kPaGの状態を示します。 ※3 最大流量時の使用圧力範囲を示します。
 ※4 最大流量時において精製器入口圧力を0.5 MPaGとした場合の圧力損失を示します。 ※5 暫定参考値ですので変更される場合があります。

水素用 バルブ無し

	適用 ガス	流量 Nℓ/min ^{※1}	型 式	使用圧力範囲 (MPaG) ^{※2}	圧力損失 (kPaG) ^{※3}	使用温度 (℃)	入口ガス 純度条件	本体材質	内蔵フィルター (μm)	重量 (kg)	接続	寿命・精製量 ^{※1 ※4} (約Nm ³)
①	H ₂	～3.0	FPH-3	0.1～0.97	5 以下	5～35	5Nガスボンベ 相当以上	SUS316L	0.003 (材質:SUS316L)	0.2	1/4VCR オス	33
②		～5.0	FPH-5		15 以下					0.3		56
③		～30.0	FPH-30		25 以下					0.7		531
④		～60.0	FPH-60	0.2～0.97	40 以下					1.0		833
⑤		～100.0	FPH-100		35 以下					1.6		1,867

※1 NℓおよびNm³とは273.15 K(0℃)で101.325 kPaGの状態を示します。 ※2 最大流量時の使用圧力範囲を示します。 ※3 最大流量時において精製器入口圧力を0.5 MPaGとした場合の圧力損失を示します。
 ※4 暫定参考値ですので変更される場合があります

水素用 バルブ付き

	適用 ガス	流量 Nℓ/min ^{※2}	型 式	使用圧力範囲 (MPaG) ^{※3}	圧力損失 (kPaG) ^{※4}	使用温度 (℃)	入口ガス 純度条件	本体材質	内蔵フィルター (μm)	重量 (kg)	接続	寿命・精製量 ^{※2 ※5} (約Nm ³)
①	H ₂	～3.0	FPH-3V	0.1～0.97	5 以下	5～35	5Nガスボンベ 相当以上	SUS316L	0.003 (材質:SUS316L)	0.8	1/4VCR メス	33
②		～5.0	FPH-5V		15 以下					0.9		56
③		～30.0	FPH-30V		25 以下					1.3		531
④		～60.0	FPH-60V	0.2～0.97	40 以下					1.6		833
⑤		～100.0	FPH-100V		35 以下					2.2		1,867
⑥ ^{※1}		～200.0	FPH-200V		22 以下					8.6	3/8VCR メス	10,200

※1 FPH-200Vのバルブ無し仕様はありません。 ※2 NℓおよびNm³とは273.15 K(0℃)で101.325 kPaGの状態を示します。 ※3 最大流量時の使用圧力範囲を示します。
 ※4 最大流量時において精製器入口圧力を0.5 MPaGとした場合の圧力損失を示します。 ※5 暫定参考値ですので変更される場合があります。

お問い合わせ

 **大阪ガスリキッド株式会社**

〒541-0041

大阪市中央区北浜四丁目7番19号 住友ビルディング第3号館5階

TEL : 06(4706)2701 FAX : 06(4706)2711

MAIL : inquiry-finepurifier@ml.liquidgas.co.jp

HP : <https://www.liquidgas.co.jp/>

